



# JORNADAS TÉCNICAS DE ETCHING EN DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

## ISOM-UPM

### ETSITelecomunicaciones

### Madrid, 12 y 13 Noviembre 2018

**Lugar:** Sala Profesores, 1º planta Edificio C, E.T.S.I.Telecomunicación. UPM

#### **12 de Noviembre del 2018**

- 11:00 Llegada de los participantes
- 11:30 Presentación de las Jornadas (Javier Martínez)
- 12:00 Ataques por RIE-ICP y químicos (Manuel Abuin)
- 13:00 Comida
- 15:00 Visita de los equipos de la Sala Blanca del ISOM
- 18:00 Fin de la jornada

#### **13 de Noviembre del 2018**

- 09:30 Técnicas de medida del etching en los dispositivos (Manuel Abuin)
- 10:15 Ataques en dispositivos de Silicio (CNM-CSIC)
- 11:00 Pausa Cafe
- 11:30 Ataques en dispositivos fotónicos (NTC-UPV)
- 12:15 Mesa Redonda: Técnicas de etching
- 13:00 Comida
- 15:00 Clausura de las Jornadas